

KOREAPAT

KOREAPAT は、KIPO (韓国特許庁) の一部門である KIPI (Korean Institute of Patent Information : 韓国特許情報院) が提供する韓国特許のデータベースです。情報は全て英語で記述されています。

当ファイルは韓国で発行された 1979-2001 年の公告特許および 2000 年以降の公開特許を収録しています。英語標題, 抄録 (KIPI 作成) に加えて, 発明者, 特許出願人, 特許番号類, 国際特許分類を収録しています。代表図面も収録しています。

収録内容

科学技術分野全般

収録源

Korean Patent abstracts (CD ROM), 審査済および未審査特許

ファイル内容

1979 年から現在まで (公開特許 (A- 特許) は 2000 年以降, 公告特許 (B- 特許) は 1979-2001 年まで)
レコード数 1,374,000 件以上 (2011 年 7 月現在)
イメージ数 1,257,000 件以上 (2011 年 7 月現在)
更新は毎月
アラート (自動 SDI 検索) は毎月実施

検索補助資料

オンラインヘルプ (HELP DIRECTORY で利用できるすべてのヘルプメッセージが表示されます)
STNGUIDE

データベース製作者

Korean Institute of Patent Information (KIPI)
6-8 th Fl. KIPS 647-9 Yeoksam-dong
2Gangnam-ku, Seoul 135-980
Korea
Phone: (+82) 2 3452 8144
Fax: (+82) 2 3453 5953
著作権所有者

データベース提供者

FIZ Karlsruhe
P. O. Box 2465
D-76012 Karlsruhe
Germany
Phone: (+49) 7247/808-555
Fax: (+49) 7247/808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de

ヨーロッパ

STN カールスルーエ

FIZ Karlsruhe
P.O. Box 2465
76012 Karlsruhe
Germany
Phone: +49-7247-808-555
Fax: +49-7247-808-259
E-mail: helpdesk@fiz-karlsruhe.de
Internet: www.stn-international.de

日本

STN 東京

一般社団法人 化学情報協会
〒113-0021 東京都文京区本駒込6-25-4 中居ビル
Phone: 0120-003-462 (Help Desk)
: 0120-151-462 (上記以外)
Fax: 03-5978-4090
E-mail: support@jaici.or.jp (Help Desk)
customer@jaici.or.jp (上記以外)
Internet: www.jaici.or.jp

北アメリカ

STN コロンバス

CAS
P.O. Box 3012
Columbus, Ohio 43210-0012 U.S.A
CAS Customer Care:
Phone: 800-753-4227 (North America)
614-447-3700 (worldwide)
Fax: 614-447-3751
E-mail: help@cas.org
Internet: www.cas.org

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

中間一致および後方一致検索可能なフィールド(/BI)はアスタリスク(*)で示してあります。

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
基本索引 * 1) 標題 (/TI) 抄録 (/AB) (以上からの切出し語)	なし または/BI	S ?PHENYLETHER? S MODEL? S FLUID AND EMULSION	TI, AB
抄録	/AB	S LADER/AB	AB
レコード番号	/AN	S 2004:000001/AN	AN
出願国 (WIPO コードおよび国名)	/AC	S KR/AC AND L1	AI
出願日 2)	/AD	S JUL-SEP 1995/AD	AI
出願番号 3),4)	/AP	S KR2000-10007/AP S KR1020000000007/AP	AI, APO
出願番号, オリジナル形式	/APO	S KR1020000000007/APO	APO
出願番号グループ 6)	/AP, /PRN	S KR2000-1001/APPS	AI, PRAI
出願年 2)	/AY	S 1999-2000/AY	AI
資料種類	/DT	S P/DT	DT
(コードおよびテキスト)	または/TC	S PATENT/DT	
入力日 2)	/ED	S ED=AUG 2004	ED
	または/UP		
フィールドの存在	/FA	S GI/FA	FA
図面イメージ容量 2)	/GIS	S GIS<=350	GIS
図面イメージ種類	/GIT	S TIF/GUT	GIT
国際特許分類	/IC	S A24B/IC	IC
	または/IPC		
発明者	/IN	S MANDEL?/IN	IN, AU
	または/AU	S SATO AKIHIRO/IN	
国際特許分類, 主分類	/ICM	S A01N001/ICM S A01B059-06/ICM	ICM, IC
国際特許分類, 副分類	/ICS	S A01G023/ICS	ICS, IC
国際特許分類, 主分類グループ 2)	/MGR	S 10-20/MGR(S)C07C/IC	ICM, ICS
(範囲指定検索用)			
国際特許分類, 副分類グループ 2)	/SGR	S C01B/ICM(S)100-2000/SGR	ICM, ICS
(範囲指定検索用)			
特許出願人 5)	/PA	S HITACHI/PA	PA
	または/CS	S NIPPON CHEM?/PA	
特許発行国 (WIPOコードおよび国名)	/PC	S KR/PC	PI, PNO
特許種別コード	/PK	S KRA/PK	PI
特許番号 3),4)	/PN	S KR200027/PN S KR100200027/PN	PI, PNO
	または/PATS		
特許番号, オリジナル形式	/PNO	S KR100200027/PNO	PNO
優先権主張国 (WIPO コードおよび国名)	/PRC	S US/PRC S UNITES STATES/PRC	PRAI
優先権主張日 2)	/PRD	S JAN-APR 2004/PRD	PRAI
優先権出願番号 3),4)	/PRN	S AT1985-25617/PRN	PRAI
優先権出願番号, オリジナル形式	/PRNO	S UK48367/PRNO	PRNO
優先権出願の種類	/PRT	S INTERNATIONAL APPLICATION/PRT	表示されない
優先権主張年 2)	/PRY	S 2003=PRY	PRAI
特許発行日 2)	/PD	S PD=FEB 1995	PI
特許発行年 2)	/PY	S PY>=2003 AND L2	PI
標題	/TI	S SUPPLYING OXYGEN/TI	TI
標題の言語	/TL	S ENGLISH/TL	TL

(続く)

SEARCHおよびDISPLAYフィールド

フィールド	SEARCH コード	SEARCH 例	DISPLAY コード
更新日 ²⁾	/UP または/ED	S L1 AND UP=JAN 2004	ED

- 1) このフィールドでは前方一致検索に加えて、中間一致および後方一致検索が可能です。語幹には少なくとも4文字が必要です。
- 2) 数値演算子あるいは範囲指定検索による検索が可能な数値検索フィールドです。
- 3) 出願番号および特許番号はダウエント形式およびSTN形式が利用できます。STN形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換はSET PAT DERWENTと入力します。STN形式に戻す場合にはSET PAT STNと入力します。
- 4) このフィールドには、オリジナルの出願番号（あるいはオリジナルの原特許番号）の入力形式も含まれています。
- 5) このフィールドでは、(S)演算子をスペースで代用できます。
- 6) このフィールドは、/APおよび/PRNを検索するためのスーパーサーチフィールドです。このフィールドではEXPANDを利用できません。個々のフィールド（/AP、/PRN）でEXPANDしてください。

DISPLAYおよびPRINT形式

回答のディスプレイとオフラインプリントには下記の表示形式を自由に組み合わせることができます。複数のコードは、“D L1 1-5 TI IN”のようにスペースやカンマで区切ってください。フィールドは指定された順序で表示されます。

すべての検索フィールドでヒットタームハイライト機能が使えます。ハイライト機能をご利用にならない場合にはSET HIGHLIGHT OFFと入力してください。システムのデフォルトはONになっています。HIT, KWIC, OCC表示形式を使うためには、検索時にハイライト機能がONになっていることが必要です。

形式	英語名	内容	入力例
AB	Abstract	抄録	D AB
AI (AP) ²⁾	Application Information	出願情報	D AP
AN	Accession Number	レコード番号	D AN
APO	Application Number, Original	出願番号, オリジナル形式	D APO
APPS	Application Number Group	出願番号グループ	D APPS
DT (TC)	Document Type	資料種類	D DT
ED (UP)	Entry Date	入力日	D ED
FA ¹⁾	Field Availability	フィールドの存在	D FA
GI ^{1),3)}	Graphic Image	図面イメージ	D GI
GIS ¹⁾	Graphic Image Size	図面イメージ容量	D GIS
GIT ¹⁾	Graphic Image Type	図面イメージ種類	D GIT
IC (IPC)	International Patent Classification (ICM, ICS)	国際特許分類 (主分類, 副分類)	D IC
ICM	IPC, Main	国際特許分類, 主分類	D ICM
ICS	IPC, Secondary	国際特許分類, 副分類	D ICS
IN (AU)	Inventor	発明者	D IN
PA (CS)	Patent Assignee	出願人	D PA
PATS (PN) ¹⁾	Patent Number Group	特許番号グループ	D PATS
PI (PN)	Patent Information	特許情報	D PI
PIT	Patent Information Publication Type	特許情報, 公開のタイプ	D PIT
PK	Patent Kind Code	特許種別	D PK
PNO ¹⁾	Patent Number, Original	特許番号, オリジナル形式	D PNO
PRAI (PRN) ²⁾	Priority Information	優先権出願情報	D PRAI
PRNO ¹⁾	Priority Number, Original	優先権出願情報, オリジナル形式	D PRNO
TI ¹⁾	Title (contains title language)	標題 (標題言語を含む)	D TI
UP	Update Date	更新日	D UP

(続く)

DISPLAYおよびPRINT形式

形式	内容	入力例
ABS	AN, AB	D ABS
ALL (MAX) ²⁾	AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC, AB	D ALL
ALLG ^{2),3)}	AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC GI AB	D ALLG
BIB ¹⁾	AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI	D BIB
DALL ²⁾	デリミタ型ALL形式	D DALL
IALL (IMAX) ²⁾	フィールド名付きインデント型ALL形式	D IALL
IALLG ^{2),3)}	フィールド名付きインデント型ALLG形式	D IALLG
IBIB ²⁾	フィールド名付きインデント型BIB形式	D IBIB
IND	AN, IPC	D IND
ISTD ²⁾	フィールド名付きインデント型STD形式	D ISTD
MAXG ^{2),3)}	AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC, GIS, GI, AB	D MAXG
SAMPLE (SAM, TRIAL, TRI, FREE)	AN, TI, IC	D SAM
SCAN ⁴⁾	TI (回答番号無しのランダム表示)	D SCAN
STD ²⁾	AN, ED, TI, IN, PA, PIT, PI, AI, PRAI, IC	D STD
HIT	ヒットタームを含むフィールド	D HIT
KWIC	ヒットタームの前後20語を表示 (KeyWord-In-Context)	D KWIC
OCC	ヒットタームの出現頻度をフィールドごとに表示	D OCC 1-6

1) カスタム形式のみの表示です。

2) 出願番号および特許番号はダウエント形式およびSTN形式が利用できます。STN形式がデフォルトです。ダウエント形式への変換はSET PAT DERWENTと入力します。STN形式に戻す場合にはSET PAT STNと入力します。

3) G4 FAX形式に圧縮されたTIFFおよびJPEGイメージを扱うプログラムであるSTN Expressなどでは、DISPL AYコマンドによりイメージをいったんダウンロードします。STN on the Webでは、イメージを直接画面に表示することができます。

4) SCAN形式は、コマンドに続けて入力します。例: D SCAN または DISPLAY SCAN

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

SELECTコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にE番号を付与します。

ANALYZEコマンドは、回答セットの指定したフィールドから抽出した語句にL番号を付与します。

SORTコマンドは、検索結果を指定したフィールドのアルファベット順または数値順に並べ替えます。

(該当項目はY, 該当しないものはNで表示されています。)

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
抄録	AB	Y	Y
出願国	AC	Y	N
出願日	AD	Y	N
レコード番号	AN	Y	Y
出願番号	AP (AI)	Y	Y
出願番号, オリジナル形式	APO	Y	Y
出願番号グループ	APPS	Y	Y
出願年	AY	Y	N
資料種類	DT (TC)	Y	Y
入力日	ED	Y	Y
フィールドの存在	FA	Y	N
素面イメージ容量	GIS	Y	N
図面イメージ種類	GIT	Y	Y
発明者	IN (AU)	Y	Y
国際特許分類 (ICM, ICS)	IPC	Y	Y
国際特許分類 (主分類, 副分類)	IC	Y	N

(続く)

SELECT, ANALYZEおよびSORTフィールド

フィールド	フィールドコード	ANALYZE/SELECT ¹⁾	SORT
国際特許分類, 主分類	ICM	Y	Y
国際特許分類, 副分類	ICS	Y	Y
特許出願人	PA (CS)	Y	Y
特許番号グループ	PATS	Y	N
特許発行国	PC	Y	Y
特許情報	PI	Y	Y
特許種別	PK	Y	Y
特許番号	PN (PI)	Y	Y
特許番号, オリジナル形式	PNO	Y	N
優先権主張国	PRC	Y	Y
優先権主張日	PRD	Y	Y
優先権出願情報	PRAI	Y	Y
優先権出願番号	PRN (PRAI)	Y	Y
優先権出願番号, オリジナル形式	PRNO	Y	N
優先権出願タイプ	PRT	Y	N
優先権主張年	PRY	Y	Y
特許発行日	PD	Y	Y
特許発行年	PY	Y	Y
標題	TI	Y (デフォルト)	Y
標題言語	TL	Y	Y
更新日	UP	Y	Y

1) ヒットタームだけを抽出させるには, HITを使います. 例: SEL HIT IN

サンプルレコード

MAXG形式での表示

```

AN 2004:017120 KOREAPAT ED 20040819
TI INTEGRATED DEVELOPER OF WET COLOR LASER PRINTER
TL English
IN SHIN, HYEON SEONG
PA SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
PIT KRA Unexamined Patent Application
PI KR 2004024813 A 20040322
AI KR 2002-56262 20020916
PRAI KR 2002-056262 * 20020916
IC
ICM G03G015-10
GIS 17524
AB PURPOSE: An integrated developer of a wet color laser printer is provided
to cut off a waste developer storage entrance so that a waste developer
stored in a waste developer storage does not flow back through the
entrance, thereby preventing the waste developer from flowing out.
CONSTITUTION: A photosensitive drum(20) has an electric charge layer, and
forms a predetermined electrostatic latent image. A developing roller(30)
moves a developer to the photosensitive drum(20) to develop the
electrostatic latent image as a visual image. An upper end of a cleaning
blade(50) is contacted with the photosensitive drum(20) to remove a
remaining waste developer. A developing cartridge(10) receives the
photosensitive drum(20), the developing roller(30), and the cleaning
blade(50). The developing cartridge(10) is divided into a developer
storage(1) and a waste developer storage(2). The developer storage(1)
stores the developer. The waste developer storage(2) stores the waste
developer removed by the cleaning blade(50). A leakage prevention
member(80) cuts off an entrance of the waste developer storage(2) so that
the waste developer does not flow back through the entrance.
.COPYRGT. KIPO 2004

```